2002/12/05

移動準備調査

担当：谷口

機器名：ガス供給系

種類：真空機器

構成：水素ボンベ、He ボンベ、減圧弁（２式）、3/8？インチ SUS 配管、開閉バルブ（６個），ピエゾバルブ（2 個）、インレットバルブ（2 個）、ICF70 絶縁短管（2 個）、SUS 配管絶縁（2 個）、ロータリーポンプ、バルブ、圧縮空気用バルブ、パルサー

入力：AC100V、ピエゾ制御用 BNC ケーブル（2 本：66 号室ピエゾコントローラーから）、圧縮空気

出力：ガス（Port2B, Port12E）

設置場所：60 号室、Port2B（RF プローブ用フィードスルーと兼用）、Port12E（Halpha 用ガラス窓と兼用）

処理方法：移動

作業要領（作業時間 x 作業人数）：

(0)調査、写真（2 時間 x１人）

(1)分解（3 時間 x１人）

(2)梱包（3 時間 x１人）（66 号室の SUS 配管部品も）

(3)記録整理印刷

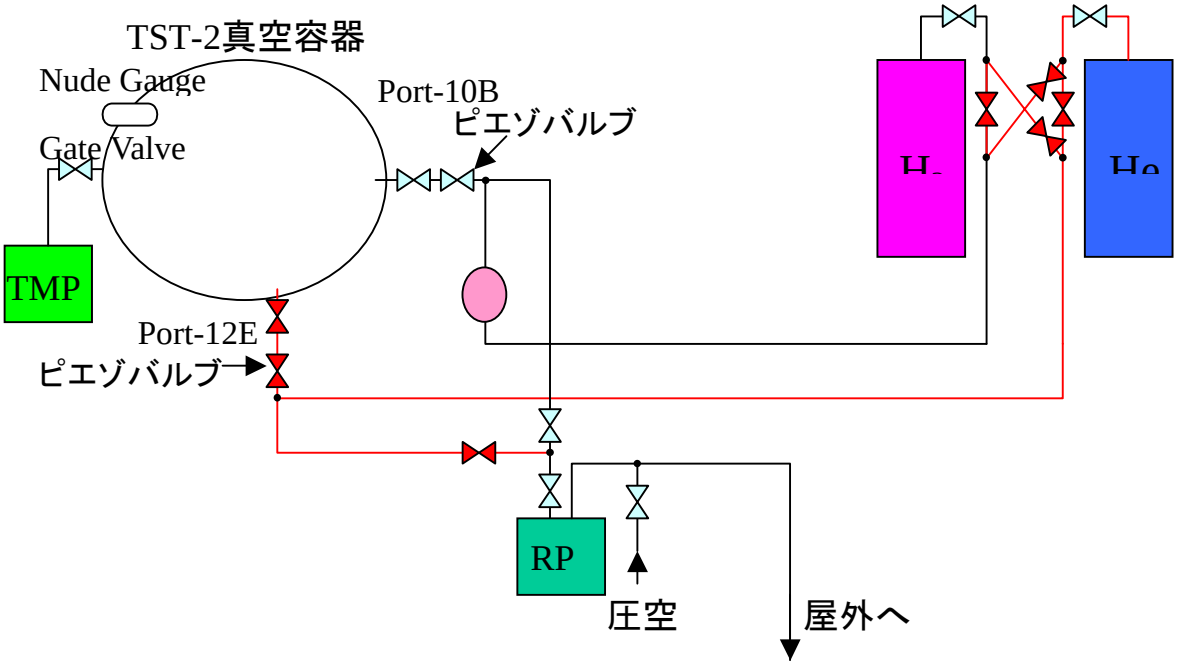
(*)業者による移動

廃棄：圧縮空気用シンフレックスチューブ

材料として持っていくもの：BNC ケーブル？

備考：部品の一部、SUS 配管部品は 66 号室にある。これらも梱包して持っていく。

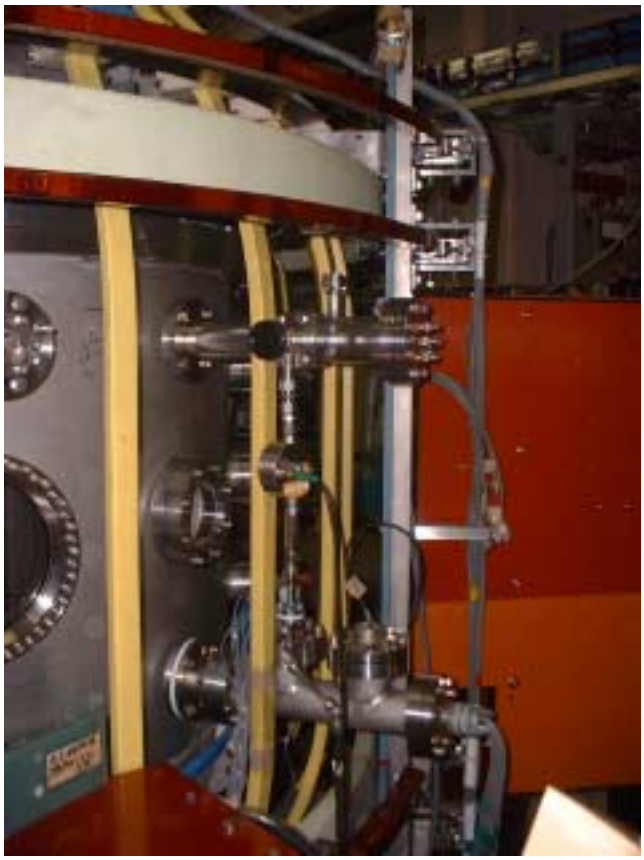
SUS 配管は柏では新設し、現在のものは材料として用いる。ボンベは業者に引き取ってもらう。



ガス供給系系統図

ガスボンベ

ロータリーポンプ



Port2B

Port12E